О параметрах электронного пучка пушки с плазменным эмиттером

© С.Ю. Корнилов, Н.Г. Ремпе, А. Beniyash, N. Murray, T. Hassel, C. Ribton

ООО "Элион", Томск, Россия Institute of Materials Science at the Leibniz University of Hannover, D-30823, Garbsen, Germany TWI Ltd., CB21 6AL, Cambridge, UK E-mail: mail@elion-tomsk.ru

Поступило в Редакцию 15 марта 2013 г.

Измерена яркость сфокусированного электронного пучка, генерируемого пушкой с плазменным эмиттером. Измерения выполнены для пучка с мощностью до 4 kW и энергией электронов 60 keV, сфокусированного на расстоянии 0.52 m от фокусирующей линзы. Впервые показано, что яркость сфокусированного пучка пушки с плазменным эмиттером не уступает яркости пучков, полученных в термокатодных пушках.

Пушки с плазменным эмиттером, предназначенные для формирования сфокусированных электронных пучков, уже длительное время используются в лучевых технологиях [1,2]. Регулировка тока в таких пушках производится по схеме диодного типа, без специального управляющего электрода. Такая схема управления током имеет известные преимущества [3], которые состоят в том, что при изменении тока электронно-оптические параметры сфокусированного пучка остаются практически стабильными, что не всегда возможно в триодных пушках с накаленным катодом.

1

12

Существенный недостаток пушек с плазменным эмиттером, по мнению специалистов в области электронно-лучевого оборудования [4], состоит в том, что пушки этого типа обеспечивают невысокую плотность тока пучка из-за большой температуры эмитированных плазмой электронов. Наши оценки, проведенные на основе известного выражения Ленгмюра, показали, что для типичных параметров плазменного эмиттера минимальный размер сфокусированного электронного пучка не должен превышать нескольких десятков µm [5]. Однако в экспериментах долгое время такой параметр не достигался. Причиной оказалась недооценка влияния на параметры пучка магнитного поля в промежутке ускорения и дрейфа электронного пучка. Источником этого поля является постоянный магнит разрядной камеры, необходимый для инициирования и горения разряда. После оптимизации поля [6] удалось получить электронные пучки с плотностью мощности около 10⁷ W/cm² [5] при относительно небольшой, до 60 keV, энергии электронов.

Информация о возможности получения в пушках с плазменным эмиттером остросфокусированных пучков является важной, однако не исчерпывающей для оценки электронно-оптических параметров пучка. Как миниимум, требуется знать яркость пучка. Высокие значения этого параметра позволяют говорить о более широкой, чем варочные технологии, области применения пушек с плазменным эмиттером. Например, перспективной становится разработка на их основе устройств с выводом пучков в атмосферу через газодинамические окна. Кроме того, пушки с высокой яркостью пучка могут быть применены в таких немассовых технологиях, как резка, "сверление" калиброванных отверстий, создание трехмерных деталей послойной электронно-лучевой наплавкой (FastEBM) и др. И наконец, нельзя забывать о том, что яркость электронного пучка — это не только технический, но и в определенной степени коммерческий (рекламный) параметр, привлекающий дополнительное внимание потребителей к пушкам с плазменным эмиттером. По этой причине важно, чтобы измерения яркости были выполнены корректно и, желательно, не только разработчиками пушек, но и независимыми экспертами.

В наших экспериментах яркость электронного пучка определялась применительно к технологии FastEBM [7]. Эксперименты выполнены на электронно-лучевой установке в Институте материаловедения Ганноверского университета им. Лейбница (Германия) (Institute of Material

Science at the Leibniz University of Hannover). В составе установки использованы электронная пушка с плазменным эмиттером и аппаратура питания, изготовленные ООО "Элион" (Россия) по заказу фирмы Perndorfer Maschinenbau KG (Австрия). Для технологии FastEBM необходимо, чтобы диаметр пучка на расстоянии около 0.5 m от центральной плоскости фокусирующей линзы составлял примерно 200 µm.

Для оценки яркости электронного пучка с гауссовым законом распределения тока по сечению может быть использовано выражение вида [3]

$$B = \frac{J_0}{\Omega},\tag{1}$$

где J₀ — плотность тока на оси пучка, которая определяется как

$$J_0 = \frac{i_b}{\pi r_f^2},\tag{2}$$

где i_b — ток пучка, r_f — эффективный радиус с пучка в фокусе.

Телесный угол Ω , в котором распространяется пучок, при малых значениях угла сходимости θ определяется из простого выражения

$$\Omega = \pi \theta^2. \tag{3}$$

В этом случае выражение (1) с учетом (2) и (3) преобразуется к виду

$$B = \frac{i_b}{\pi^2 r_f^2 \theta^2}.$$
 (4)

По экспериментально полученным значениям r_f и θ с использованием выражения (4) выполнены расчеты яркости электронного пучка пушки с плазменным эмиттером. Для измерения угла сходимости и радиуса сфокусированного пучка пушка размещалась неподвижно на вакуумной установке.

Принцип действия пушки основан на эмиссии электронов из плазмы газового разряда под действием высоковольтного электрического поля. Эмитирующая плазма создается в низковольтном отражательном разряде с полым катодом [8]. Разряд этого типа содержит два противостоящих катода, в одном из которых имеется полость, представляющая собой электростатическую ловушку для электронов, в другом — эмиссионное отверстие. Для увеличения пробега электронов между катодами создается магнитное поле с индукцией около 0.08 Т.



Рис. 1. Внешний вид измерительного комплекса.

Давление плазмообразующего газа (воздух) в разрядной камере выше, чем в вакуумной установке, и составляет примерно $1 \cdot 10^{-2}$ mbar. Повышенное давление в разрядной камере создается дозированным напуском газа с величиной около 0.25-0.33 sccm. Разряд горит в непрерывном режиме с напряжением 350-400 V и током от 0.1 до 1.5 A. Такие параметры разряда позволяют получать электронный пучок с током от единиц до нескольких сотен миллиампер.

Эмиссия электронов из плазмы происходит через отверстие в катоде в область ускоряющего поля между этим катодом и заземленным высоковольтным анодом. Ускоренный электронный пучок, как и в термокатодной пушке, в эквипотенциальном пространстве фокусируется магнитной линзой и отклоняется магнитными катушками.

Для измерения диаметра электронного пучка использовался измерительный комплекс (рис. 1), разработанный в компании TWILtd. (Кембридж, Великобритания).

Измерительный комплекс включал следующие основные элементы.

1. Зонд, содержащий два расположенных под углом 90° датчика тока электронов, в каждом из которых выполнена узкая щель. Датчики



Рис. 2. Типичный вид сигналов с датчиков и цилиндра Фарадея (*a*) и сигнала при пересечении электронным пучком плоскости одного датчика со щелью (*b*): *I* — щель; *2* — датчик; *3* — сечение электронного пучка.

позволяют измерять ширину электронного пучка по двум координатам — X и Y.

2. Цилиндр Фарадея, предназначенный для измерения тока пучка независимо от приборов, установленных в аппаратуре электропитания электронной пушки. Цилиндр Фарадея конструктивно и электрически соединен с датчиками.

3. Коллектор, способный продолжительное время выдерживать воздействие электронного пучка мощностью до 40 kW.

4. Система сбора и обработки экспериментальных данных.



Рис. 3. Иллюстрация методики расчета угла сходимости.

Принцип действия измерительного комплекса заключается в следующем. Зонд и цилиндр Фарадея устанавливаются на необходимом расстоянии от фокусирующей линзы. Электронный пучок фокусируется в плоскости зонда и разворачивается. По мере движения (рис. 1) электронный пучок последовательно пересекает датчик с X-щелью, цилиндр Фарадея и датчик с Y-щелью. Траектория развертки пучка представляет собой треугольник.

Сигнал с цилиндра Фарадея и датчиков передается в систему сбора и обработки экспериментальных данных. Типичный вид полученного сигнала изображен на рис. 2, *а*.

Для точного измерения ширины пучка по обеим координатам необходимым условием является неизменность скорости (частоты) развертки пучка.

Момент появления и форма сигнала датчика поясняются схемой, приведенной на рис. 2, b. Точки a и e схемы соответствуют моменту времени первого и последнего контакта пучка с датчиком. Промежуток времени между точками a и e на сигнале пропорционален ширине датчика. В момент времени, соответствующий точкам b и d, пучок

Характеристики электронного пучка пушки с плазменным эмиттером

Ток пучка, mA	Диаметр пучка в линзе, mm	Диаметр пучка в фокусе, mm	Угол сходи- мости, 10 ⁻³ rad	Яркость, $10^{10} \text{A} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1}$
10	2.18	0.55	1.6	0.5
20	1.90	0.56	1.5	1.2
40	3.18	0.58	2.5	0.8
60	3.06	0.46	2.7	1.6

проникает в щель своей периферийной частью. В точке *с* через щель проходит центральная (осевая) часть пучка.

Методика измерения угла сходимости и радиуса сфокусированного электронного пучка заключалась в следующем.

Зонд перемещался вдоль оси пучка и фиксировался на расстоянии b от центральной плоскости фокусирующей линзы (рис. 3). Это расстояние по условиям измерений равнялось 520 mm. При постоянных значениях тока пучка и ускоряющего напряжения пучок фокусировался линзой так, чтобы в плоскости зонда был острый фокус. Радиус сфокусированного электронного пучка r_f , прошедшего через щель, определялся на полувысоте распределения тока.

Далее, при постоянном токе фокусирующей линзы (фиксированном положении плоскости острого фокуса) перемещением зонда вдоль оси пучка определялся радиус пучка r_b в других плоскостях. Полученный таким образом профиль пучка вдоль оси z аппроксимировался линейной зависимостью вида

$$r_b = az + r_l,\tag{5}$$

где $a = \tan(\theta)$, z — координата зонда вдоль оси распространения пучка; r_l — радиус пучка в фокусирующей линзе.

С использованием выражения (5) и условия z = 0 определялся радиус пучка в линзе. По известным значениям r_l и r_f рассчитывался угол сходимости электронного пучка

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{r_l - r_f}{b} \right). \tag{6}$$

По результатам измерений рассчитывалась яркость электронного пучка для токов от 10 до 60 mA. В эксперименте поддерживались

постоянными ускоряющее напряжение ($U_{acc} = 60 \text{ kV}$), расход плазмообразующего газа (Q = 0.3 sccm) и положение плоскости фокусировки электронного пучка (b = 520 mm).

В таблице представлены результаты измерений диаметра сфокусированного электронного пучка, а также рассчитанные по выражениям (4)-(6) яркость, диаметр пучка в линзе и угол сходимости.

Из таблицы следует, что яркость электронного пучка в пушках с плазменным эмиттером составляет около $1 \cdot 10^{10} \text{A} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1}$, что соответствует яркости электронных пучков, полученных с помощью термокатодных пушек с катодом из LaB₆ [4].

Таким образом, впервые показано, что пушки с плазменным эмиттером могут формировать сфокусированные электронные пучки с яркостью, не меньшей, чем яркость пучка в термокатодных пушках.

Список литературы

- [1] Osipov I.V., Rempe N.G. // Rev. Sci. Instrum. 2000. V. 71. N 4. P. 1638-1641.
- [2] Rempe N., Kornilov S., Beniyash A., Hassel T. // Welding and Cutting. 2012.
 V. 11. N 2. P. 122–127.
- [3] Molokovsky S.I., Sushkov A.D. Intense electron and ion beams. Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005.
- [4] Кайдалов А.А. Электронно-лучевая сварка и смежные технологии. Киев: Экотехнология, 2004 (Kaydalov A.A. Electron beam welding and related technologies. Kiev: Ekotekhnologiya, 2004).
- [5] Корнилов С.Ю., Осипов И.В., Ремпе Н.Г. // ПТЭ. 2009. № 3. С. 104–109 (Kornilov S.Yu., Osipov I.V., Rempe N.G. // Instr. Exp. Tech. 2009. V. 52. N 3. P. 406–411).
- [6] Корнилов С.Ю., Ремпе Н.Г. // ЖТФ. 2012. Т. 82. В. 2. С. 79-84.
- [7] *Ribton C.N.* // Lectures of second International Electron Beam Welding Conference. Aache, Germany, March 26–30, 2012. P. 148–151.
- [8] Галанский В.Л., Груздев В.А., Осипов И.В., Ремпе Н.Г. // Изв. вузов. Физика. 1992. № 5. С. 5–23 (Galanskii V.L., Gruzdev V.A., Osipov I.V., Rempe N.G. // Russian Physics Journal. 1992. V. 35. N 5. P. 401–416).